開示の要約

研磨装置

研磨液による遮蔽を抑えながら基板の表面温度を測定することができる研磨装置が開示される。研磨装置は、マイクロ波を検出することでマイクロ波検出データを生成するマイクロ波検出センサと、マイクロ波検出データに基づいて、基板の表面温度を決定する制御装置と、を備える。

図２